

真空乾燥装置

SONS ENGINEERING CO., LTD.

http : www.sons-gr.co.jp

洗浄後の最適な乾燥を行うために開発しました。

窒素置換方式を機能向上させた特殊真空乾燥装置 特許出願中

洗浄後の不純物付着物防止と時間短縮に成功した乾燥装置です。

自然乾燥や従来式真空乾燥方式では水分が空気中の酸素等との結合により、ウォーターマーク（イオンデポジット）が発生しやすく悩みの種でした。

【イオンデポジット】

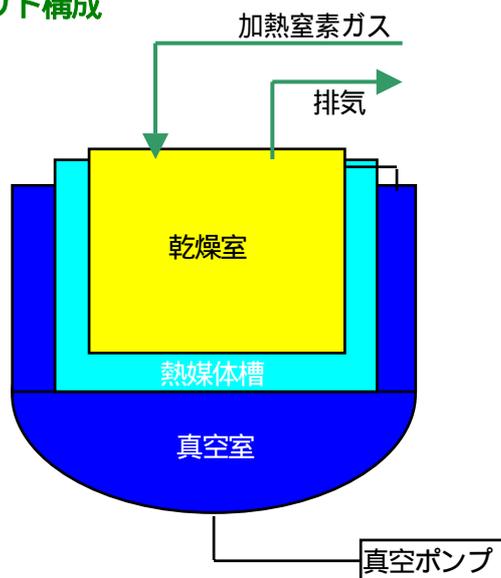
水滴が乾いたように見えるシミ、ごく薄く盛り上がり、全体的に白く見えるのが特徴
これは水分に含まれる成分とO₂（酸素）が反応した物質が水分の蒸発後に取り残された物で、水は面積を減らして蒸発する特性から**王冠状の縁**として残る。

市販の乾燥機は乾燥のみを追及したものが多く、コーティング処理等を前提とした乾燥ノウハウはコーティング処理加工を行う各会社独自のものが先端技術として保持されている事が多く、公開されることは稀であります。

この特殊真空乾燥装置は弊社の長年にわたるコーティング装置メーカーとして又超音波洗浄装置メーカーとしてのノウハウの蓄積により開発できた装置です。

構造の単純化で高性能ながら低価格を実現しました。

ユニット構成



本体構造

真空室、乾燥室、熱媒加熱層の3槽構造式
(SUS316)

真空ポンプ

オイルフリースクロール真空ポンプ

加熱窒素ガス

ガス加熱ヒーターによる窒素ガス加熱

制御盤

シーケンサー、温度調節器

操作盤

タッチパネル操作による自動運転

株式会社サンズエンジニアリング

いわき営業所 Tel : 0246-26-8011 Fax : 0246-26-8012

乾燥までの流れ

予め熱媒によって保温されている（約 90℃）乾燥室に乾燥対象物を投入します。

乾燥室内に加熱窒素ガスを流し、乾燥対象物を温めます。

乾燥室を真空引きし、水分の沸点を下げます。

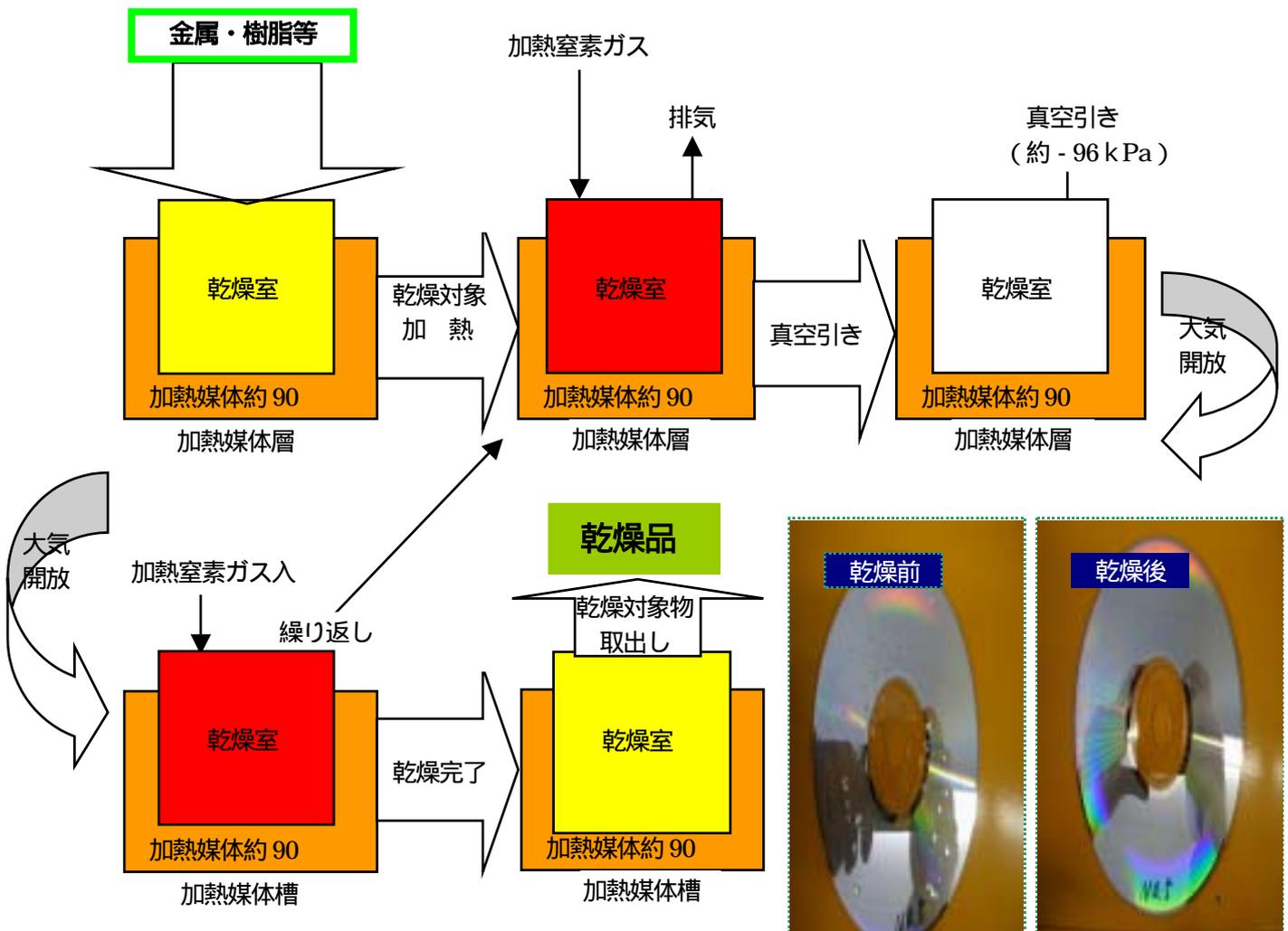
加熱窒素ガスにて真空状態を開放します。

乾燥対象物を取り出します。

形状・数量等の条件で ～ の繰返回数を決めます



VDS - 2002型



株式会社サズエンジニアリング

取扱代理店

http : www.sons-gr.co.jp
email : ho@sons-gr.co.jp